05 О рассеянии рентгеновских лучей на многослойных пористых структурах

© В.И. Пунегов, А.А. Ломов

Коми научный центр УрО РАН, Сыктывкар Институт кристаллографии РАН, Москва E-mail: vpunegov@dm.komics.ru

Поступило в Редакцию 13 июля 2009 г.

На основе формализма статистической динамической теории дифракции разработана модель, описывающая когерентное и диффузное рассеяние ренттеновских лучей от многослойных пористых кристаллов. Проведено численное моделирование карт распределения интенсивности рассеяния от пористых систем. Показано, что существенную роль в формировании контуров равной интенсивности играет статистическое усреднение по размерам пор. Сравнительный анализ экспериментальных данных и численных расчетов позволил получить усредненные параметры пористых структур InP, включая размеры пор и величину латерального квазипериода.

Пористые низкоразмерные структуры представляют значительный интерес не только как объект исследования фундаментальных свойств материи, но и возможность их широкого использования в приборостроении (см. [1] и приведенную в этой работе литературу). Исследование этих структур началось с появления пористого кремния еще в середине прошлого века. С развитием технологии удалось формировать пористые слои на монокристаллических подложках других полупроводниковых материалов. Электрохимическое травление в режиме анодирования традиционно используется для создания пористых слоев, поскольку легко позволяет получать как одиночные, так и многослойные структуры с толщинами от сотых долей до нескольких десятков микрон. В зависимости от технологических условий в приповерхностных слоях образуются различные по структурным параметрам поры и кристаллиты, которые существенно меняют электрофизические свойства анодирования областей. Поэтому развитие методов структурных исследований таких слоев

60

имеет важное значение. Было показано [2–4], что высокоразрешающая рентгеновская дифрактометрия очень чувствительна к "архитектуре" пористых слоев. Однако для извлечения количественной информации из рентгенодифракционных измерений необходимо развитие адекватных теоретических подходов для таких систем.

Настоящая работа посвящена разработке модели, описывающей рассеяние рентгеновских лучей от пористых кристаллов в рамках формализма статистической динамической теории дифракции, и ее применению для анализа экспериментальных данных от многослойной пористой структуры на подложке InP(001).

На основе метода рекуррентных соотношений [5] рассмотрим рассеяние рентгеновских лучей на *N*-слойном пористом кристалле. Нумерацию слоев проведем снизу вверх. Каждый такой слой, например с номером *n*, имеет свои структурные характеристики: пористость слоя P_n , относительную деформацию кристаллической решетки ε_n , статический фактор Дебая-Валлера f_n . Пористость слоя связана с относительной плотностью слоя $v_n = \rho_n/\rho_0$ соотношением $P_n = 1 - v_n$, где ρ_0 и ρ_n — плотности слоев до и после анодирования.

Амплитудный коэффициент отражения когерентных рентгеновских волн от *N*-слойной пористой системы можно записать в виде рекуррентного соотношения

$$R_N(q_x, q_z) = \frac{S_{N-1}^{(1)} b_N^{(2)} - S_{N-1}^{(2)} b_N^{(1)}}{S_{N-1}^{(1)} - S_{N-1}^{(2)}} \Phi(q_x),$$
(1)

где

$$S_{N-1}^{(1)} = (R_{N-1} - b_N^{(1)}) \exp(i\xi_N l_N), \quad S_{N-1}^{(2)} = (R_{N-1} - b_N^{(2)}),$$
$$b_N^{(1,2)} = \frac{\xi_N^{(1,2)}}{a_{-h}(1 - P_N)f_N},$$

 R_{N-1} — амплитудный коэффициент отражения от (N-1) нижних слоев. Параметры

$$\xi_N = \sqrt{(-q_z - \varepsilon_N h)^2 - 4a_h a_{-h} (1 - P_N)^2 f_N^2}, \quad \xi_N^{(1,2)} = \frac{(q_z - \varepsilon_N h) \pm \xi_N}{2}$$

зависят от деформации решетки, пористости слоя и статического фактора Дебая-Валлера. Здесь $a_{h,\bar{h}} = C\pi \chi_{h\bar{h}}/(\lambda \gamma_{h,0})$ — динамические

коэффициенты [5], q_x , q_z — компоненты вектора **q**, определяющего отклонение вектора рассеяния $\mathbf{k}_h - \mathbf{k}_0$ от узла обратной решетки **h**, где $\mathbf{k}_{0,h}$ — волновые векторы падающего и дифракционного рентгеновского пучка. Параметр $\phi(q_x)$ связан с шириной засветки рентгеновским пучком поверхности образца.

Если поры в соседних слоях не имеют вертикальной пространственной корреляции, то диффузное рассеяние от произвольного *n*-слоя не зависит от структурных характеристик соседних слоев и может быть записано в виде

$$I_n^d(q_x, q_z) = |a_h|^2 P_n^2 (1 - f_n^2) S_0 l_n \bar{\tau}_n(q_x, q_z), \qquad (2)$$

где S_0 — площадь засветки рентгеновским пучком поверхности кристаллического слоя, l_n — толщина слоя, $\bar{\tau}_n(q_x, q_z)$ — корреляционная площадь с учетом усреднения по радиусу пор R и длине пор l имеет вид

$$\bar{\tau}(q_x, q_z) = L(q_x) \int_{-\infty}^{\infty} dl \int_{-\infty}^{\infty} dR p(L, R) \frac{(\operatorname{sinc}(q_z l/2))^2}{2\pi} lS(q_x, R).$$

Здесь sinc(x) = sin(x)/x, функция $S(q_x, R)$ определена в [3]. Статистический разброс по размерам пор задается функцией плотности вероятности p(l, R), $L(q_x)$ — фактор, учитывающий пространственную корреляцию пор в латеральном направлении [4]. Если поры расположены под углом к поверхности пористой структуры, в выражении для корреляционной площади следует произвести преобразование координат [3]. При существовании вертикальной корреляции пор в многослойной системе вместо решения (2) для интенсивности диффузного рассеяния получается более сложное выражение [6].

В рамках изложенной выше теории проведено численное моделирование углового распределения интенсивности рассеяния рентгеновских лучей от многослойной пористой структуры InP. Модельный кристалл состоит из четырех одинаковых бислоев. Толщина верхнего слоя $0.8\,\mu$ m, его пористость 0.7, статический фактор Дебая-Валлера 0.5. Для нижнего переходного слоя эти параметры равны 0.2, 0.2 и 0.9 μ m соответственно. В целом многослойная система толщиной 4 μ m лежит на совершенной полубесконечной подложке. Средний радиус пор составляет 40 nm, средняя длина — 200 nm, величина дисперсии во всех



Рис. 1. Расчетные карты распределения интенсивности рассеяния от многослойного пористого кристалла. Контуры равной интенсивности представлены в логарифмическом масштабе, отношение между соседними линиями составляет 0.237. *а* — кристалл с вертикальными порами, *b* — кристалл с наклонными порами, *c* — кристалл с вертикальными и наклонными порами, *d* — случай (*c*), все поры одного размера.

случаях в три раза меньше размера пор. Расчетные карты интенсивности рассеяния показаны на рис. 1.

Если во всех слоях присутствуют только вертикальные поры с указанными значениями пористости и статического фактора Дебая—Валлера, контуры равной интенсивности диффузного рассеяния вытя-

нуты вдоль горизонтального и вертикального направлений (рис. 1, a). Рис. 1, b демонстрирует дифракционную картину от структуры, в которой поры во всех слоях расположены под углом $\pm 45^{\circ}$ к поверхности кристалла. При наличии в толстых слоях вертикальных пор, а в тонких переходных слоях — наклонных пор, угловое распределение интенсивности рассеяния имеет более сложный вид (рис. 1, c). Более того, если в этом случае поры одинакового размера, интенсивность диффузного рассеяния имеет осцилляционный характер (рис. 1, d).

Следовательно, для анализа экспериментальных результатов статистическое усреднение по размерам пор имеет существенное значение. Предложенный формализм применен для исследования полного (когерентного и диффузного) дифракционного рассеяния от пористых систем InP вблизи рефлекса 004 с учетом априорной информации технологических условий и данных электронной микроскопии. Идеальная технологическая схема предполагала наличие четырех слоев. Однако в процессе электрохимического травления в режиме анодирования при переключении напряжения формировались дополнительные переходные слои толщиной 100-400 nm. Кроме того, в расчетах учитывалось, что верхний слой образца, в котором возникает нуклеация пор, имеет отличающуюся морфологию по сравнению с нижними слоями. Если в нижних слоях поры имеют колончатую структуру, то в верхнем слое наблюдается неоднородное и хаотическое расположение пор. Интерфейсы между слоями не имеют строгой планарности и содержат наклонные поры. Алгоритм вычислений учитывал статистический разброс радиуса пор, их длины, а также угла наклона оси пор к поверхности образца. Статистическое усреднение по указанным структурным характеристикам проводилось с использованием логарифмического нормального распределения [4,7].

Экспериментальные измерения были выполнены на немецком синхротронном источнике DESY методом высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии. Использовалось излучение с энергией 10 keV (длина рентгеновской волны $\lambda = 0.12398$ nm). Распределение интенсивности вблизи (004) отражения от подложки InP регистрировалось позиционно-чувствительным детектором. Сравнительный анализ экспериментальных измерений и численных расчетов проводился для 2 азимутальных положений образцов: (A) — составляющая q_x параллельна направлению [110] и (B) — направлению [1–10].



Рис. 2. Экспериментальные (a, c) и теоретические (b, d) карты распределения интенсивности рассеяния многослойного пористого кристалла InP. a, b — азимутальное положение (A), c, d — азимутальное положение (B).

На рис. 2 изображены экспериментальные (a, c) и теоретические (b, d) карты распределения интенсивности рассеяния от многослойного пористого кристалла, полученного в гальваностатическом режиме. Толщины четырех бислоев, начиная от поверхности, равнялись 0.9 + 0.1, 1.1 + 0.2, 1.1 + 0.3, $1.2 + 0.4 \mu$ m. На всех картах контуры равной интенсивности представлены в логарифмическом масштабе, отношение между соседними линиями составляет 0.237. Численным моделированием было установлено, что образец преимущественно

Радиус	Длина	Радиус	Длина	Отношение	Латераль-	Латераль-	Угол
наклон-	наклон-	вертикаль-	вертикаль-	количества	ный квази-	ный квази-	на-
ных пор	ных пор	ных пор	ных пор	наклонных	период	период	клона
$R_{sl}, (\sigma),$	$l_{sl}, (\sigma),$	$R_v, (\sigma),$	$l_v, (\sigma),$	пор к верти-	$T_{[110]}, (\sigma),$	$T_{[1-10]}, (\sigma),$	пор
nm	nm	nm	nm	кальным	nm	nm	$\alpha,^{\circ}$
45	160	55	250		80	100	
(15)	(80)	(25)	(100)	4	(20)	(45)	47-56

Средние характеристики пор и их дисперсия δ

содержит кристаллографически ориентированные поры, расположенные под углом к поверхности в пределах $47-56^{\circ}$. Однако присутствуют и перпендикулярные к поверхности токовые (TO) поры. В среднем количество кристаллографически ориентированных пор в четыре раза больше токовых пор. В положении (A) латеральная плотность пор приблизительно в 1.3 раза больше, чем в случае (B). Структурные характеристики пористой системы InP, полученные численным моделированием, представлены в таблице.

Авторы выражают благодарность D. Nohavica и P. Gladkov (Institute of Photonics and Electrhonics, Academy of Sciences CR, Prague, Czech Republic) за предоставление образцов пористых кристаллов, а также А.Л. Васильеву, А.А. Карцеву (Институт кристаллографии РАН), Д.В. Новикову (DESY, Germany) за помощь в экспериментальных измерениях и обсуждение результатов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 07-02-00090-а) и Программы президиума РАН № 27.

Список литературы

- Lloyd-Hughes J., Merchant S.K.E., Sirbu L., Tiginyanu I.M., Johnston M.B. // Phys. Rev. B. 2008. V. 78. P. 085320 (1–4).
- [2] Ломов А.А., Прохоров Д.Ю., Имамов Р.М., Нохавика Д., Гладков П. // Кристаллография. 2006. Т. 51. № 5. С. 49–55. Lomov A.A., Prokhorov D.Yu., Imamov R.M., Nohavica D., Gladkov P. // Crystallography Reports. 2006. V. 51. N 5. P. 806–812.

- [3] Punegov V.I., Lomov A.A., Shcherbachev K.D. // Physica status solidi (a). 2007.
 V. 204. N 8. P. 2620–2625.
- [4] Пунегов В.И., Ломов А.А. // Письма в ЖТФ. 2008. Т. 34. В. 6. С. 30–35. *Punegov V.I., Lomov A.A.* // Tech. Phys. Lett. 2008. V. 34. N 3. P. 238–240.
- [5] Punegov V.I. // Physica status solidi (a). 1993. V. 136. N 1. P. 9-19.
- [6] Пунегов В.И. // Письма в ЖТФ. 2008. Т. 34. В. 20. С. 8–14. Punegov V.I. // Tech. Phys. Lett. 2008. V. 34. N 10. P. 864–866.
- [7] Boulle A., Conchon F., Guinebretière R. // Acta Cryst. A. 2006. V. 62. N 1. P. 11–16.